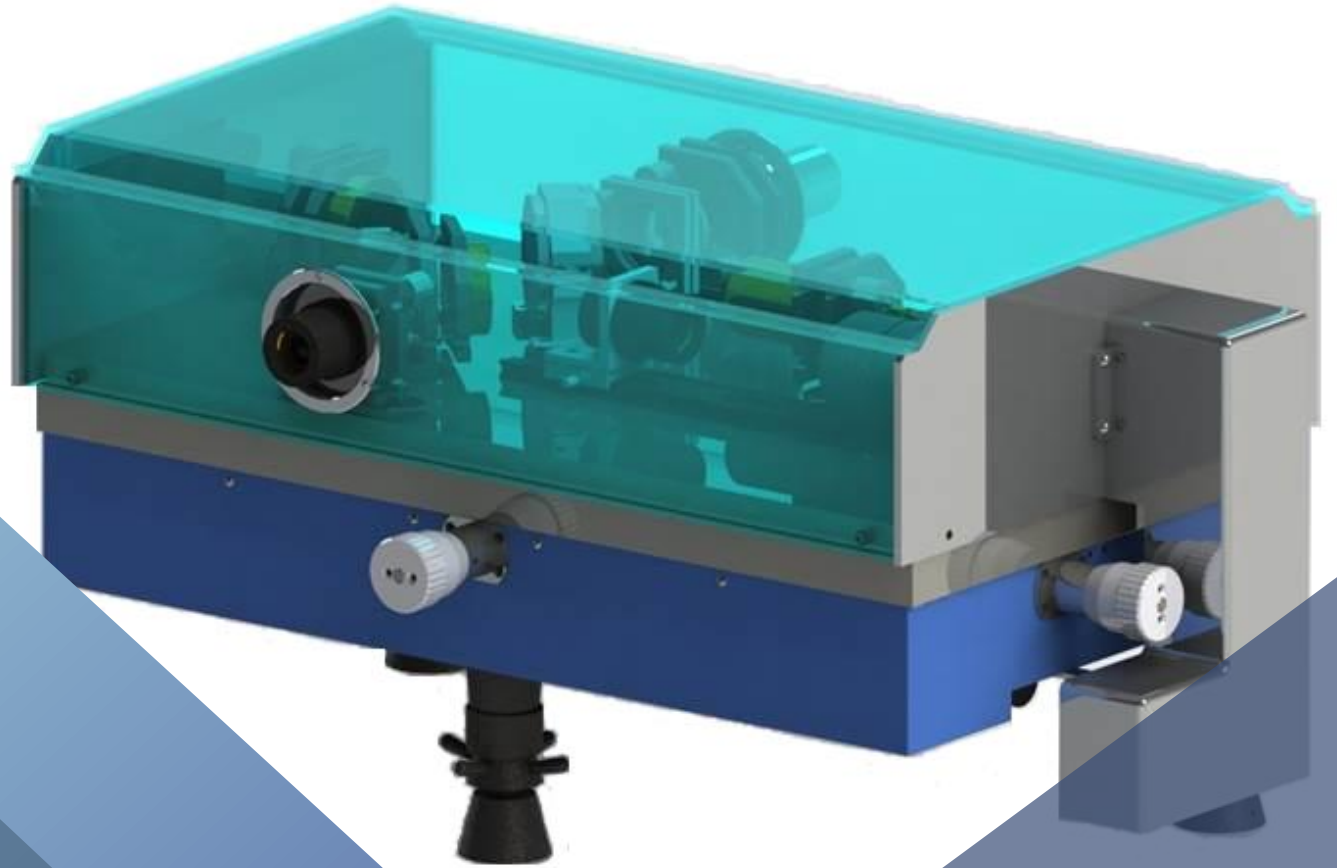




ЭЛЕКТРО
СТЕКЛО

Интерферометр ПИК-ПАС

Прибор интерференционного контроля ПИК-ПАС предназначен для контроля формы плоских, сферических и асферических поверхностей 2-го и более высоких порядков с использованием индивидуальных нуль-корректоров (голограммы) и внеосевых параболических зеркал, устанавливаемых в рабочую ветвь прибора (интерферометра).



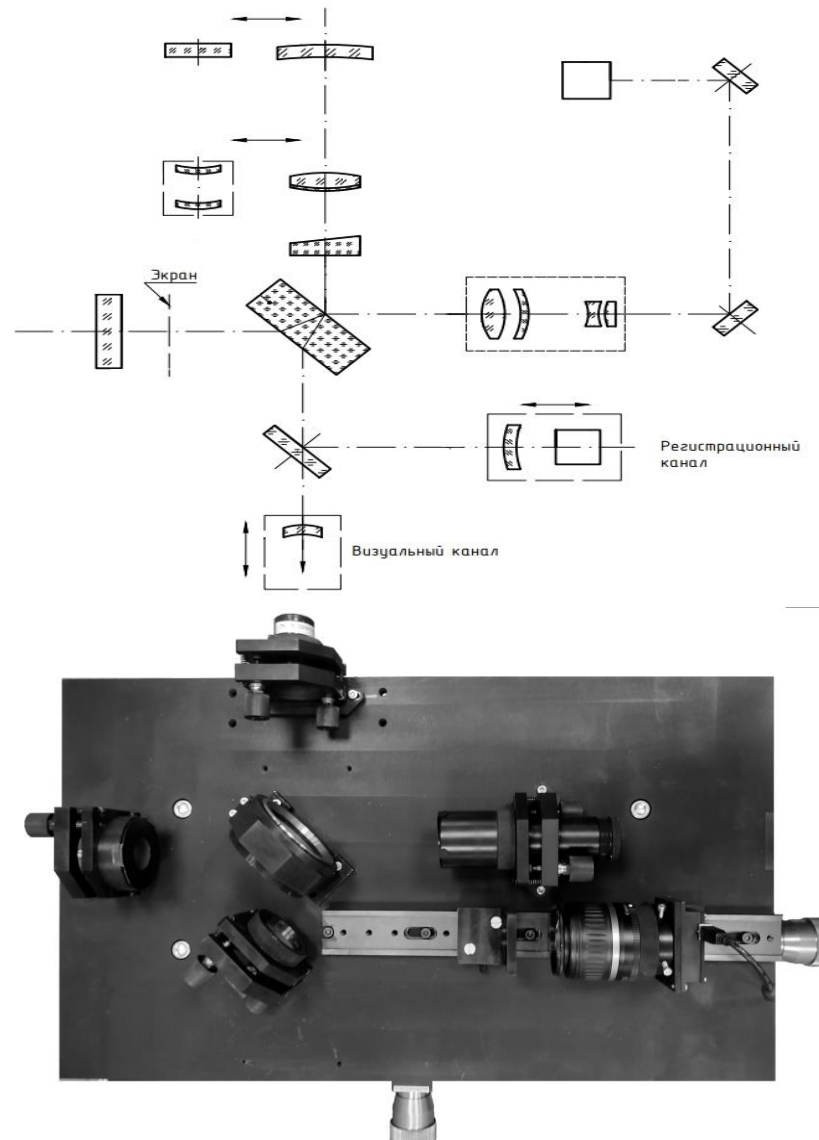
119571, г. Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров д.5

(495) 234-59-51

shmeleva@elektrosteklo.ru

www.elektrosteklo.ru

Оптическая схема



Принцип работы прибора ПИК-ПАС заключается в формировании интерференционной картины от исследуемой поверхности объекта и ее последующей регистрации на электронном носителе.

Для контроля асферических поверхностей в модуль объектива рабочей ветви устанавливаются индивидуальный нуль-корректор либо голограмма, рассчитанные для конкретного вида асферической поверхности.

Характеристики

Форма контролируемых оптических поверхностей	Сферические, асферические поверхности 2-го и более высоких порядков
Диаметр параллельного пучка лучей в рабочей ветви, мм	28
Длина волны лазерного излучения, λ , мкм	0,632 0,532
Мощность лазерного излучения, мВт, не менее	10
Модовый состав излучения	Одномодовый (мода TE_{M00q})
Поляризация излучения	Неполяризованное
Среднее квадратическое отклонение измеренного волнового фронта с точностью	$\lambda/80$ ($\lambda=0,632\text{мкм}$)
Среднее квадратическое отклонение измеренного волнового фронта методом фазовых шагов с точностью	$\lambda/500$ ($\lambda=0,632\text{мкм}$)
Комплект сменных объективов рабочей ветви с относительным отверстием рабочей ветви для λ_1 и λ_2	1:3 1:6
Обработка результатов измерений	Специальное программно-математическое обеспечение для анализа интерферограмм и подготовки протоколов исследований
Масса, кг	75
Габариты (Д x Ш x В), мм	770x850x440

Внесен в госреестр РФ в качестве средства измерения

Срок службы 15 лет